



PBMS용 입자 집속 효율 측정 모듈

특허등록번호

10-1378293

특허명

최적유량조절을 위한 입자 복합특성
측정장치 배기 시스템

대표발명자

대외협력실 강상우



실시간 오염입자 측정장치

반도체나 디스플레이를 생산할 때 나노입자들이 잘못 공정되어 소자가 오염될 경우 불량품이 발생하게 됩니다. 이러한 오염입자를 실시간으로 측정하는 장치, 즉 PBMS의 효율성을 확보해주는 기술을 소개합니다! 바로 KRISS의 'PBMS용 입자 집속 효율 측정 모듈'인데요.

입자의 확산 정도를 측정하여 입자 크기에 따른 최적의 포집장치 크기를 결정하고, 입자 빔 질량 분광 광도계를 제공하는 오염입자 실시간 측정기술 이전을 통해 반도체와 디스플레이 제품의 경쟁력을 더욱 높여보세요!

